

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第1区分
【発行日】令和7年6月18日(2025.6.18)

【国際公開番号】WO2024/075462
【出願番号】特願2024-555674(P2024-555674)
【国際特許分類】
G 0 1 L 1 9 / 1 4 (2 0 0 6 . 0 1)
【 F I 】
G 0 1 L 1 9 / 1 4

10

【手続補正書】
【提出日】令和7年2月25日(2025.2.25)
【手続補正1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】

【請求項1】

20

上壁を有するパッケージ外装体と、
MEMSチップとを備え、
前記MEMSチップは、メンブレンを有し、かつ前記パッケージ外装体の内部空間に配置されており、
前記上壁には、前記上壁を厚さ方向に貫通している複数の孔が形成されている、圧力センサ。

【請求項2】

30

前記パッケージ外装体は、ケースと、リッドとをさらに有し、
前記ケースは、側壁と、前記側壁の下端に連なっている底壁とを有し、
前記リッドの平面視における外周縁部は、前記側壁の上端に接合されており、
前記リッドは、前記上壁を構成している、請求項1に記載の圧力センサ。

【請求項3】

ゲル材をさらに備え、
前記ゲル材は、前記MEMSチップを封止するように前記内部空間に充填されている、
請求項2に記載の圧力センサ。

【請求項4】

前記複数の孔のうちの1つである第1孔は、平面視において、前記複数の孔のうちの他の1つである第2孔と前記リッドの中央に関して対称な位置にある、請求項2に記載の圧力センサ。

【請求項5】

40

前記複数の孔は、平面視において、格子状に配列されている、請求項2に記載の圧力センサ。

【請求項6】

前記複数の孔の各々の開口径は、20 μ m以上300 μ m以下である、請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の圧力センサ。

【請求項7】

ケース及びリッドを有するパッケージ外装体と、
MEMSチップとを備え、
前記ケースは、側壁と、前記側壁の下端に連なっている底壁とを有し、
前記側壁の上端は、平面視において、複数の第1領域と複数の第2領域とに区分されて

50

おり、

前記複数の第1領域の各々は、前記複数の第2領域のうちの隣り合う2つの間にあり、前記リッドの平面視における外周縁部は、前記複数の第2領域にのみ接合されており、前記MEMSチップは、メンブレンを有し、かつ前記パッケージ外装体の内部空間に配置されている、圧力センサ。

【請求項8】

ゲル材をさらに備え、

前記ゲル材は、前記MEMSチップを封止するように前記内部空間に充填されている、請求項7に記載の圧力センサ。

【請求項9】

前記外周縁部には、複数の切り欠きがあり、

前記複数の切り欠きの各々からは、前記内部空間が露出している、請求項7又は請求項8に記載の圧力センサ。

【請求項10】

前記複数の切り欠きのうちの1つである第1切り欠きは、平面視において、前記複数の切り欠きのうちの他の1つである第2切り欠きと前記リッドの中央に関して対称な位置にある、請求項9に記載の圧力センサ。

10

20

30

40

50